

## 第 31 回 MEMS 講習会・ORIST 技術セミナー

「MEMS 技術を利用した地域活性化 - センシング技術・高機能薄膜が切り拓く可能性 -」

- 日時： 2019 年 2 月 7 日 (木) 13:00-18:00、意見交換会 ~19:00
- 場所： 地方独立行政法人大阪産業技術研究所  
和泉センター 研修室 (1)  
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2 - 7 - 1  
(地図： [https://orist.jp/gaiyou/access/access\\_izumi/](https://orist.jp/gaiyou/access/access_izumi/))
- 参加費： 無料
- 主催： 一般財団法人マイクロマシンセンター
- 共催： 地方独立行政法人大阪産業技術研究所  
センシング応用技術研究会

一般財団法人マイクロマシンセンター (MMC) では、MEMS 産業の裾野を広げ、その産業推進の一助となるべく活動を展開しています。本 MEMS 講習会は、MMC 賛助会員企業、特に MEMS の試作 (MEMS ファンドリー) や設計ツール開発をサービスとする企業を中心に企画され、年 2 回実施しています。

今回は「センシング技術・高性能薄膜が切り拓く可能性」をテーマに、高機能薄膜に強みを持つ地方独立行政法人大阪産業技術研究所と、センシング応用技術研究会との共催で、MEMS に興味を持たれている企業との技術交流会を行います。MEMS 分野で先進的な研究開発をされている大学からのご講演と、大阪の産業界、ファンドリー企業の双方からの報告で、プログラムを構成いたしました。MEMS に取り組む際の不安材料となるデバイスの開発・生産に関しましても技術相談会を最後に設けております。最先端の技術開発や地域での産業化の課題等を議論する最適な場になればと企画しましたので、沢山の方々のご参加をお待ち致します。

### プログラム

#### 【開会の挨拶】 13:00-13:10

主催者挨拶 (一財) マイクロマシンセンター 専務理事 長谷川 英一  
共催者挨拶 (地独) 大阪産業技術研究所 理事長 中許 昌美

#### 【基調講演】 13:10-14:10

「無線センサネットワークの社会実装～端末自立化の課題」  
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 伊藤 寿浩

#### 【特別講演 1】 14:10-14:50

「ウェアラブルセンシングとその応用」  
神戸大学大学院 工学研究科 教授 寺田 努

#### 【特別講演 2】 14:50-15:30

「MEMS における圧電薄膜～基盤技術(物質開発・製膜・評価)から応用まで～」  
大阪府立大学大学院 工学研究科 准教授 吉村 武

===== 休憩 15:30-15:40 =====

#### 【産業界からのご報告】

- 15:40-16:00 「高耐熱ひずみ抵抗薄膜を用いた小型圧力センサの開発」  
日本リニアックス(株) 応用製品部 副部長 松元 光輝
- 16:00-16:20 「MEMS デバイス製造装置の最新技術と動向」  
SPP テクノロジーズ(株) マーケティング部  
マーケティングコミュニケーショングループ長 金尾 寛人

- 16:20-16:50 「移動体通信向け弾性波フィルタの開発と進展」  
太陽誘電(株) 複合デバイス事業本部 マイクロデバイス開発室 室長 西原 時弘
- 16:50-17:10 「塗布法による有機半導体デバイスの作製とフレキシブルセンサへの応用」  
(地独) 大阪産業技術研究所 研究管理主幹 宇野 真由美

**【ファンドリサービス産業委員会からの報告】**

- 17:10-17:30 「MEMS ファンドリネットワークの活動と各企業のサービス紹介」  
ファンドリサービス産業委員会 委員長 浅野 雅朗

**【技術相談会】**

- 17:30-18:00 パネル展示による技術相談会

===== 休憩 18:00-18:10 =====

**【意見交換会】 18:10-19:00**

- 18:10-19:00 (地独) 大阪産業技術研究所 和泉センター 食堂  
(\*プログラムはやむを得ず変更になる場合がございますのでご了承下さい。)

■定員: 60名

尚、この「MEMS 講習会」に合わせて、翌日 2 月 8 日 (金)、9 時 30 分から「(地独) 大阪産業技術研究所 和泉センター」の見学会を予定しています。ご参加を希望される方は、申込書にご記入ください。

**見学会プログラム (2 月 8 日 (金) 9:30~11:30)**

- 9:30 大阪産業技術研究所 和泉センター 研修室 (5) に集合
- 9:35-10:00 「大阪産業技術研究所のご紹介 ~各種センサ、環境発電素子、高機能性薄膜等~」  
大阪産業技術研究所 和泉センター  
電子・機械システム研究部 電子デバイス研究室長 村上 修一
- 10:00-11:00 大阪産業技術研究所 和泉センター見学  
MEMS・成膜関係の実験室、3D 造形・プリンタ、電波暗室等
- 11:00-11:30 研修室 (5) にて、質疑応答、解散

==== 参加申込欄 ====

第 31 回 MEMS 講習会 <2019 年 2 月 7 日(木)>

「MEMS 技術を利用した地域活性化 - センシング技術が切り拓く可能性 -」

氏名:

会社・団体名:

所属部署:

Email:

TEL:

以下についてもご記入をお願いします。

意見交換会 : ( ) 参加 ( ) 不参加  
2 月 8 日 (金) 見学会 : ( ) 参加 ( ) 不参加

=====

■ web 申込: <http://fsic.nanomicro.biz/seminar/koshu-31/>



お問合せ: 一般財団法人マイクロマシンセンター

MEMS 協議会 MEMS 講習会担当 産業交流部 小出 / 酒向

事務局 E-mail: [mems-ws@mmc.or.jp](mailto:mems-ws@mmc.or.jp)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸 67 MBR99 ビル 6 階

Tel: 03-5835-1870 / Fax: 03-5835-1873 / <http://www.mmc.or.jp/>